

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成25年11月7日(2013.11.7)

【公開番号】特開2012-11372(P2012-11372A)

【公開日】平成24年1月19日(2012.1.19)

【年通号数】公開・登録公報2012-003

【出願番号】特願2010-269960(P2010-269960)

【国際特許分類】

B 01 D	53/86	(2006.01)
B 01 J	35/02	(2006.01)
B 01 J	37/02	(2006.01)
B 01 J	37/34	(2006.01)
B 01 D	53/94	(2006.01)
C 01 B	17/78	(2006.01)
B 01 D	53/60	(2006.01)
B 01 D	53/74	(2006.01)
B 01 D	53/14	(2006.01)

【F I】

B 01 D	53/36	Z A B J
B 01 J	35/02	J
B 01 J	37/02	3 0 1 K
B 01 J	37/34	
B 01 D	53/36	1 0 2 D
B 01 D	53/36	D
B 01 D	53/36	G
C 01 B	17/78	
B 01 D	53/34	1 3 2 Z
B 01 D	53/14	1 0 2

【手続補正書】

【提出日】平成25年9月18日(2013.9.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

気相中の有害物質として、高濃度の窒素酸化物や硫黄酸化物が共存する環境下においては、第1次側の装置として窒素酸化物を除去する薬剤としてアミン化合物水溶液を用いるとともに、第2次側の装置として、光触媒材料と希薄な過酸化水素溶液の共存下で処理する分解方法にて硫黄酸化物を除去する方法。

【請求項2】

前記アミン化合物が、トリエタノールアミン、メチルアミン及びモルホリンから選ばれる化合物であることを特徴とする請求項1記載の方法。

【請求項3】

気相中の有害物質である硫黄酸化物から、硫酸を作製する請求項1または2記載の方法。

【請求項4】

前記光触媒材料が、金属チタン又はチタン合金表面にチタン窒化物を形成させた後、陽極

酸化処理することにより得られた結晶性酸化チタン皮膜を有する光触媒材料であることを特徴とする請求項1～3のいずれかに記載の方法。

【請求項5】

前記結晶性酸化チタンが、アナターゼ型酸化チタンであることを特徴とする請求項4に記載の方法。

【請求項6】

前記希薄な過酸化水素溶液の過酸化水素濃度が、1重量%以下であることを特徴とする請求項1～5のいずれかに記載の方法。